

## 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

REC'D 21 APR 2005

WIPO

PCT

出願人代理人  
吉武 賢次

様

あて名

〒 100-0005  
東京都千代田区丸の内三丁目2番3号  
富士ビル323号  
協和特許法律事務所PCT  
国際調査機関の見解書  
(法施行規則第40条の2)  
[PCT規則43の2.1]発送日  
(日.月.年)

19.4.2005

出願人又は代理人  
の書類記号

151515-248

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

PCT/JP2004/019417

国際出願日

(日.月.年)

24.12.2004

優先日

(日.月.年)

26.12.2003

国際特許分類 (IPC)

Int. Cl.

H01L21/027, G03F7/30

出願人 (氏名又は名称)

東京エレクトロン株式会社

## 1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎  
☐ 第II欄 優先権  
☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成  
☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如  
☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明  
☐ 第VI欄 ある種の引用文献  
☐ 第VII欄 国際出願の不備  
☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

## 2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

## 3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

01.04.2005

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)  
岩本 勉

2M

9355

電話番号 03-3581-1101 内線 3274

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

## 第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、\_\_\_\_\_ 語による翻訳文を基礎として作成した。  
それは国際調査のために提出された PCT 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ ☐ 配列表  
☐ 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット ☐ 書面  
☐ コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる  
☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された  
☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、  
それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-25	有 無
	請求の範囲		
進歩性 (IS)	請求の範囲		有 無
	請求の範囲	1-25	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-25	有 無
	請求の範囲		

## 2. 文献及び説明

文献1 : JP 11-111603 A (大日本スクリーン製造株式会社) 1999. 04. 23  
文献2 : JP 11-156278 A (大日本スクリーン製造株式会社) 1999. 06. 15  
文献3 : JP 2001-274082 A (東京エレクトロン株式会社) 2001. 10. 05  
文献4 : JP 2003-303752 A (株式会社日立製作所) 2003. 10. 24  
文献5 : JP 2001-102292 A (東京エレクトロン株式会社) 2001. 04. 13

## ・請求の範囲1-25

請求の範囲1-25に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1-5より進歩性を有しない。文献1及び2には、複数の吐出口を直線上に配置したノズルを備え、基板を鉛直軸回りに回転させた状態で、当該ノズルを基板の外側から中央部に向かって移動させて基板表面に現像液を螺旋状に供給する現像装置が記載されている。また、文献3-5には、細長い帯状に現像液を供給するノズルであって、現像液の温度調整部、濃度調整部、複数の現像液ノズル、リンス液供給ノズル等を備え、これらノズルを基板上で移動して現像液を供給する現像装置が記載されている。

文献1-5に記載の現像装置が、いずれも現像液を供給するという同一の技術に関するものであるから、文献1, 2の発明において、文献3-5に記載の各種ノズルを適用して請求の範囲1-25に記載された発明をすることは、当業者が容易になし得たことである。

そして、レジストの種類、およびレジストパターンの線幅等の幾何学的特徴を考慮して現像液の濃度及び温度を設定することは、当業者にとって自明なことである。